



KINTEK SOLUTION

Isostatic Press 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



자동 실험실 냉간 등압 프레스 Cip 장비 냉간 등압 성형

품목 번호: PCIA



소개

자동 실험실 냉간 등압 프레스로 효율적으로 시료를 준비하십시오. 재료 연구, 약학 및 전자 산업에서 널리 사용됩니다. 전기 CIP에 비해 더 큰 유연성과 제어를 제공합니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 110mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 130mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)
가공 공정 가압	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 압력 해제
압력 변환	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	7인치 LCD 디스플레이
장비 보호	유리문이 있는 강판 보호	유리문이 있는 강판 보호	유기 유리문이 있는 강판 보호	유기 유리문이 있는 강판 보호
등압	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa
압력 챔버 등압	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
시료 제조 특성	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동
외부 치수	240×390×560(길이×너비×높이)	280×460×660(L×W×H)	/	330×580×720(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)
장비 무게	120KG	180KG	240KG	290KG

전기 실험실 냉간 등압 프레스 Cip 기계

품목 번호: PCIE



소개

당사의 전기 실험실 냉간 등압 프레스로 기계적 특성이 향상된 조밀하고 균일한 부품을 생산하십시오. 재료 연구, 약학, 전자 산업에서 널리 사용됩니다. 효율적이고 컴팩트하며 진공 호환 가능.

자세히 알아보기

기기 모델	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
압력 범위	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
피스톤 직경	95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	110mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa
최대 피스톤 스트로크 (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
압력 방식	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압
압력 보충 방법	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압
가드	유기 유리	유기 유리	유기 유리	유기 유리
주변 온도	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
등압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
등압 챔버	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
외부 치수	305×430×530mm(L×W×H)	305×430×600mm(L×W×H)	355×450×710mm(L×W×H)	405×470×720mm(L×W×H)
전원 공급 장치	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)
장비 무게	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg

전고체 배터리 연구용 온간 등방압 프레스(Wip)

품목 번호: PCIH



소개

반도체 적층 공정을 위한 첨단 온간 등방압 프레스(WIP)를 만나보세요. MLCC, 하이브리드 칩, 의료용 전자 부품에 이상적입니다. 정밀한 제어로 강도와 안정성을 향상시킵니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
압력 범위	0-20T	0-40T	0-60.0 톤	0-100 톤
피스톤 직경	130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	200mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	220mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제			
유지 시간	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분
압력 변환	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환			
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
가열 온도	상온-200.0°C	상온-200.0°C	상온-200.0°C	상온-200.0°C
등방압	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
등방압 챔버 크기	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150 (M×N)	Φ50×150 (M×N)

전기 분할 실험실 등압 성형기 Cip 장비

품목 번호: PCESI



소개

분할식 등압 성형기는 더 높은 압력을 제공할 수 있어 고압이 필요한 테스트 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
압력 범위	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 160mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 290mm (d)
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 변환	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
등압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
등압 챔버	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
실린더 스트로크 (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
외부 치수	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)
장비 무게	350kg	580kg	680kg	980kg

수동 등압 성형기 Cip 펠렛 프레스

품목 번호: PCIM



소개

실험실용 수동 등압 성형기는 재료 연구, 제약, 세라믹 및 전자 산업에서 널리 사용되는 고효율 시료 준비 장비입니다. 압축 공정을 정밀하게 제어할 수 있으며 진공 환경에서도 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
압력 범위	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 95mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 110mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 130mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm (d)
압력 게이지	압력 및 압력 이중 스케일 표시	압력 및 압력 이중 스케일 표시	압력 및 압력 이중 스케일 표시	압력 및 압력 이중 스케일 표시
최대 피스톤 스트로크 (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
보호대	유기 유리	유기 유리	유기 유리	유기 유리
주변 온도	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
등압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
등압 챔버	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
외부 치수	305×195×530mm(L×W×H)	305×195×600mm(L×W×H)	355×215×710mm(L×W×H)	405×240×720mm(L×W×H)
장비 무게	90Kg	100Kg	130Kg	180Kg

압력 변환		
실제 압력	챔버 압력	시스템 압력
1.7 [톤]	1.86 [MPa]	25 [MPa]
3.5 [톤]	3.72 [MPa]	50 [MPa]
5 [톤]	5.57 [MPa]	75 [MPa]
7 [톤]	7.43 [MPa]	100 [MPa]
8.7 [톤]	9.29 [MPa]	125 [MPa]
10.5 [톤]	11.2 [MPa]	150 [MPa]
14 [톤]	14.8 [MPa]	200 [MPa]
17.5 [톤]	18.6 [MPa]	250 [MPa]
21 [톤]	22.3 [MPa]	300 [MPa]

참고: 일반적으로 시스템 압력은 35MPa를 초과하지 않아야 장비 수명에 영향을 미치지 않습니다.



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

